

## 2011 年新春電子顕微鏡解析技術フォーラムのご案内

(社) 日本顕微鏡学会・デバイス解析分科会  
事務局 水尾 有里  
mizuo@nstr.co.jp

拝啓

新春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。さて、1月7日(金)に開催致します「電子顕微鏡解析技術フォーラム」の詳細について下記のとおりご連絡致します。ご連絡が遅くなりましたことをお詫び致します。

敬具

### 1. 日時

2011 年 1 月 7 日 (金) 10:30 ~ 16:35, 懇親会 16:50~18:50 (受付開始:10:00~)

### 2. 会場

#### (1) 講演会場

(財) ファインセラミックスセンター (JFCC)

(名古屋市熱田区六野二丁目 4 番 1 号, TEL : 052-871-3500 (代))

<http://www.jfcc.or.jp/>

#### (2) 懇親会場

ゼンゼロ神宮店

<http://gourmet.walkerplus.com/154156075002/>

### 3. プログラム

別紙をご参照下さい。

### 4. ざっくばらんトークについて

- (1) 「ざっくばらんトーク」では、日頃の身近な問題点を討議いたします。討議事項について予め、PowerPoint ファイルをご持参頂きたくお願い致します。電子顕微鏡写真をご持参頂くと、より具体的な議論を行うことが可能です。Power Point ファイルは USB メモリかご自身の PC でご持参下さい。
- (2) 参加者の皆様から事前に頂いていた質問リストを添付しますので、回答や知見がある方は準備をお願いします。
- (3) 今回はプログラムの関係上、ざっくばらんトークの時間が短いため、事前質問を頂いた方、資料のご準備がある方を優先させていただきます。

### 5. 服装

カジュアルな服装(ノーネクタイ)で活発な議論をしたいと思っております。なお、JFCC 殿の見学がございますので、G パンはご遠慮ください。

以上

(社) 日本顕微鏡学会・デバイス解析分科会

## 2011 年新春電子顕微鏡解析技術フォーラムプログラム

1 月 7 日 (金)

10:00 受付開始

10:30-10:40 開会挨拶とオリエンテーリング 平山 司 (JFCC)、鈴木敏洋 (トプコンテクノハウス)

「チュートリアル」 司会：和田 充弘 (三井金属)

10:40-11:40 イオン注入によって形成されるドーパントプロファイル 川崎洋司 (ルネサスエレクトロニクス)

11:40-12:40 EAG (Evans Analytical Group) における SIMS を用いた半導体材料の不純物評価  
大淵真澄 (ナノサイエンス)

12:40-13:20 昼食

13:20-14:00 JFCC 見学 佐藤岳志 (JFCC)

「ホログラフィー」 司会：鈴木敏洋 (トプコンテクノハウス)

14:00-15:00 電子線ホログラフィーの原理・手法と磁性体・半導体観察への応用 平山 司 (JFCC)

15:00-15:30 電子線ホログラフィーによる全固体リチウム電池反応のその場観察 山本和生 (JFCC)

15:30-15:40 ティーブレイク

「一般講演」 司会：長澤忠広 (日本電子)

15:40-15:55 冷却付き SEM 用断面試料作製装置 Ilion 押川浩之 (トプコンテクノハウス)

「ざっくばらんトーク」 司会：乾 光隆 (セイコーエプソン)

15:55-16:30 ざっくばらんトーク 全員参加

16:30-16:35 閉会の辞 鈴木敏洋 (トプコンテクノハウス)